



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора -
директор по научной работе

» / 12 2024 г.

РАСПИСАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ В I СЕМЕСТРЕ 2024-2025 УЧЕБНОГО ГОДА

<i>Курс</i>	<i>Наименование дисциплины, форма контроля</i>	<i>Научная специальность/ профиль</i>	<i>Дата, время проведения</i>	<i>Место проведения</i>
I (ФГТ)	Иностранный язык (англ.) (допуск к кандидатскому экзамену)	2.2.1.; 2.2.2.	21.01.2025, 13.00	ауд. 217
	Иностранный язык (англ.) (кандидатский экзамен)	2.2.1.; 2.2.2.	03.02.2025, 10.30.	ауд. 217
II (ФГТ)	Иностранный язык (англ.) (допуск к кандидатскому экзамену)	2.2.1.; 2.2.2.	21.01.2025, 13.00	ауд. 217
	Иностранный язык (англ.) (кандидатский экзамен)	2.2.1.; 2.2.2.	03.02.2025, 10.30.	ауд. 217
III (ФГТ)	Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств (допуск к кандидатскому экзамену)	2.2.2.	31.01.2025, 14.40	ауд. 302
	Вакуумная и плазменная электроника (допуск к кандидатскому экзамену)	2.2.1.	31.01.2025, 14.40	ауд. 217
	Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств (кандидатский экзамен)	2.2.2.	07.02.2025, 14.40	ауд. 302
	Вакуумная и плазменная электроника (кандидатский экзамен)	2.2.1.	07.02.2025, 14.40	ауд. 217

IV (ФГОС)	Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств (кандидатский экзамен)	профиль – Т/т эл-ка	07.02.2025, 14.40	ауд. 302
	Вакуумная и плазменная электроника (кандидатский экзамен)	профиль - Вакуумная и плазменная эл-ка	07.02.2025, 14.40	ауд. 217
V (ФГОС)	Сдача академической задолженности по дисциплинам и научным исследованиям	профили: Т/т эл-ка, Вакуумная и плазменная эл-ка	03.02.2025 – 07.02.2025	

Заведующий аспирантурой

